

Пилотная Установка Ректификации С Двойным Режимом Работы Для Практического Обучения Процессам И Аппаратам

Артикул: LPK-SMTJL



введение

Промышленная пилотная установка ректификации с двойным режимом работы для практической подготовки инженеров-химиков. Оснащена режимами работы с реальными и модельными средами, ситчатотарельчатой колонной со смотровыми стеклами для визуального наблюдения гидродинамики, а также настраиваемой SCADA-системой управления для безопасного практического изучения процессов и аппаратов и массопередачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Тип колонны	Ситчатая колонна с однопоточным сливным устройством и интегрированными смотровыми стеклами
Режимы работы	Двойной режим: Реальная среда (активный процесс) и Модельная среда (на основе моделей с водой/воздухом)
Компоновка конструкции	Двухуровневая промышленная стальная платформа с желтыми защитными ограждениями (высота 1,2 м) и безопасной лестницей
Настил платформы	Рифленый противоскользящий лист из углеродистой стали толщиной 3 мм
Система управления	SCADA-программное обеспечение на базе ПК с функцией сбора данных в реальном времени, регулирования параметров и блокировками безопасности
Ключевые приборы	Расходомеры (ротаметры), датчики температуры, датчики давления и уровнемеры
Вспомогательное оборудование	Подогреватель питания, кипятильник, дефлегматор, делитель флегмы, сборники дистиллята и кубового остатка
Габаритные размеры	Стандартная площадь: 3930 мм × 2560 мм × 3900 мм (настраивается под высоту потолков лаборатории)

Ссылка на учебник	Соответствующие процессы и аппараты и теоретические концепции
Процессы и аппараты химической технологии	Фракционная перегонка, метод Мак-Кэба-Тиле для расчета теоретических тарелок, эффективность тарелок колонны, влияние флегмового числа и гидродинамика тарельчатых колонн (проскок, захлебывание, нагрузка).
Транспортные процессы и принципы процессов разделения (ранее Транспортные процессы и процессы и аппараты)	Равновесие пар-жидкость (РПЖ), многокомпонентная массопередача, непрерывная ректификация, тепловые и материальные балансы для ректификационных колонн и конденсаторов.
Проектирование в химической технологии	Проектирование процессов в пилотном масштабе, контуры КИПиА и управления, масштабирование оборудования и стандарты безопасности процессов при работе на пилотных установках.